

Линия ионной имплантации и магнетронного напыления KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумные технологические системы



Технический лист

Система для имплантации металлических ионов в поверхность кварцевых изделий и нанесения многослойных металлических покрытий

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Система	Линия ионной имплантации и магнетронного напыления KYKY
Группа оборудования	вакуумные системы и автоматизированный контроль
Тип	вакуумная технологическая система
Предельный вакуум	≤5×10 ⁻⁵ Па
Скорость натекания	≤0,67 Па/ч
Точность позиционирования	±0,5 мм
Неравномерность толщины пленки	≤5 %
Максимальная температура	500 °C
Точность регулирования температуры	±1 °C
Мишени распыления	6 шт.

Назначение

Оборудование применяется в составе специализированного вакуумного процесса. Конфигурация формируется по техническому заданию и согласуется с параметрами изделия и производственного цикла.

Что учитывать при подборе

- 1
- целевое давление и время цикла

2	объём, материал и температура объекта
3	состав насосов, арматуры и измерительных каналов
4	автоматизация, безопасность и обслуживание

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru